平成29年11月24日(金) シンクロトロン光利用者研究会 XAFS解析講習会

XAFS測定入門

名古屋大学 シンクロトロン光研究センター 田渕雅夫







ビームライン概略図

1 BL5S1:硬X線XAFS・蛍光X線



実験ハッチ内の様子























EXAFS(Extended X-ray Absorption Fine Structure)





電子は波でもある

運動量
$$p = \hbar k$$
: k は波としての電子の波数 ($k = \frac{2\pi}{\lambda}$)
運動エネルギー $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$

入射 $X線のエネルギー E_X$ からポテンシャルVを引いた 残り(ΔE)が、運動エネルギーになるので、

$$\Delta E = E_X - V = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \implies k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} \Delta E} \implies \lambda = 2\pi \sqrt{\frac{\hbar^2}{2m\Delta E}}$$

電子は、 エネルギー(ΔE)が大きいほど、波長(λ)が短い「波」になる。

- 電子は波でもある
- 電子波の発生源(原子)を中心に周りに広がる(進行する)
- 周辺の原子によって散乱される





• 電子は波でもある

← ′ \ / `

- 電子波の発生源(原子)を中心に周りに広がる(進行する)
- 周辺の原子によって散乱される
- 散乱されて、元の原子の場所に戻ってくる波(後退波)は
 進行波と干渉して、「定在波」を作る

 $\land \land \land \land \land \land \land \land \land \land \land$

AAAAAA進行波と後退波が干渉すると、動かずに振幅が変動する波になる。







 $V: \mathbf{A} \cdot \mathbf{p} \quad \hat{e} \cdot \mathbf{r}$ 光の偏光方向の単位ベクトル。

例えば $\hat{e} = (1,0,0)$ なら $V: oldsymbol{A} \cdot oldsymbol{p} \propto \hat{e} \cdot oldsymbol{r} = oldsymbol{x}$

双極子近似による吸収係数 $\mu \propto \sum |\langle \psi_f | \hat{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{r} | \psi_i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar \omega)$ $\langle \psi_f | x | \psi_i \rangle = \int \psi_f^* x \, \psi_i \, dx$ 「終」状態の波動関数 「始」状態の波動関数 「始」状態が原子に束縛された状態なら、 1) その波動関数は小さな範囲でだけ値を持つので、 終状態の波動関数の吸収原子の位置での大きさが重要 「始」状態が S 軌道、外乱部分が x (直線偏向の光)なら、 2)「終」状態の平面波はx方向に進行する。 3)「終」状態が、x方向の奇関数の時、吸収が大きくなる 偶関数の時、小さくなる。







EXAFS(Extended X-ray Absorption Fine Structure)



特定原子種の局所構造(配位子の種類、数、距離)がわかる。

EXAFSスペクトルに含まれる情報



典型的な金属箔のスペクトル



EXAFS(Extended X-ray Absorption Fine Structure)



特定原子種の局所構造(配位子の種類、数、距離)がわかる。



XANES に見られる変化 (1): 価数



Study of the Jahn–Teller Distortion in LiNiO₂, a Cathode Material in a Rechargeable Lithium Battery, by *in Situ* X-Ray Absorption Fine Structure Analysis

Izumi Nakai,¹ Kouta Takahashi, Youhei Shiraishi, Tatsuji Nakagome, and Fumishige Nishikawa*

Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Science University of Tokyo, Kagurazaka, Shinjuku, Tokyo 162, Japan; and *Battery Development Laboratory, Asahi Chemical Industry, Ltd., Yako, Kawasaki, Kanagawa 210, Japan



FIG. 2. The Fourier transforms of the Ni K-edge and Co K-edge EXAFS spectra of (a) $\text{Li}_{1-x}\text{NiO}_2$ and (b) $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2$ as a function of x. The Fourier transforms are not corrected for the phase shifts.


陶磁器に含まれる鉄 価数選別二次元マッピング



主にFe²⁺(7.12keV励起)



双極子近似による吸収係数 $\mu \propto \sum |\langle \psi_f | \hat{\boldsymbol{e}} \cdot \boldsymbol{r} | \psi_i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i - \hbar \omega)$ $\langle \psi_f | x | \psi_i \rangle = \int \psi_f^* x \, \psi_i \, dx$ 「終」状態の波動関数 「始」状態の波動関数 「始」状態が原子に束縛された状態なら、 1) その波動関数は小さな範囲でだけ値を持つので、 終状態の波動関数の吸収原子の位置での大きさが重要 「始」状態が S 軌道、外乱部分が x (直線偏向の光)なら、 2)「終」状態の平面波はx方向に進行する。 3)「終」状態が、x方向の奇関数の時、吸収が大きくなる 偶関数の時、小さくなる。

XAFS Study of Ti-Silicalite: Structure of Framework Ti(IV) in the Presence and Absence of Reactive Molecules (H₂O, NH₃) and Comparison with Ultraviolet-Visible and IR Results

S. Bordiga, S. Coluccia, C. Lamberti,[†] L. Marchese, and A. Zecchina[•] Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica, Fisica e Chimica dei Materiali, Via P. Giuria 7, I-10125 Torino, Italy





Figure 2. Silicalite framework where $[TiO_4]$ is substituting for a $[SiO_4]$ building unit. Inset a: $[TiO_4]$ unit surrounded by four $[SiO_4]$ units (the Ti(IV) center is represented by a black ball). Inset b: after water hydrolysis of a Ti-O-Si bridge shown in a inset a (black balls indicate Ti(IV) and hydroxyl groups).

Figure 1. XANES spectra of Ti-silicalite: (1) [TSa] outgassed at 300 K; (2) [TSa] outgassed at 400 K. (The zero of the energy scale was taken at 4964.2 eV, which corresponds to the maximum of the first peak of a titanium foil K edge.)



Tiはシリケートの骨格に入り4配位となる。 その構造は吸湿・脱水で可逆的に変化する。 アンモニアとの反応で可逆的にアナターゼに近い構造を作る。

EXAFS測定可能な元素









XAFS Study of Ti-Silicalite: Structure of Framework Ti(IV) in the Presence and Absence of Reactive Molecules (H₂O, NH₃) and Comparison with Ultraviolet-Visible and IR Results

S. Bordiga, S. Coluccia, C. Lamberti,[†] L. Marchese, and A. Zecchina[•] Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica, Fisica e Chimica dei Materiali, Via P. Giuria 7, I-10125 Torino, Italy

U0010000 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Energy (eV.)







```
物質中の Ti の 3d 軌道の「形」は、
「理想的な 3d軌道」の「形」とは異なる。
= 他の軌道の「形」が混ざる。
```



Figure 4. XANES spectra of [TSa] outgassed at 400 K, the effect of NH₃ adsorption and desorption: (1) [TSa] in vacuo; (2) after dosage of NH₃ (equilibrium pressure of 10⁴ Pa); (3) effect of pumping at room temperature for 10 min (energy scale as in Figure 1); (4) TiO₂ (anatase).







Enhanced protection of carbon-encapsulated magnetic nickel nanoparticles through a source-based synthetic strategy, M.P. Fernandez-Garcia, P. Gorria, M. Sevilla, J.A. Blanco, J. Physical Chemistry C, 2013.





XANESスペクトル

原子の「状態」によって変わる。 「状態」 = 価数、軌道、スピン…

原子の「環境」には直接は依存しない。 「環境」 = 原子間距離、配位数、配位種、立体配置

間接的には依存する ex.「原子間距離が変わると価数が変わる」 「配位数が変わると軌道の形が変わる」 ニワトリと卵

従って、パターン認識的に(絵として見て)解析できることが多い。 Athena/Artemis を使うなら、Athena の守備範囲。





EXAFSスペクトル

原子の「状態」の影響はほぼない。 「状態」 = 価数、軌道、スピン…

原子の「環境」によって変化する。 「環境」=原子間距離、配位数、配位種、立体配置

解析を行うには、「原子間距離」、「配位数」などのパラメータを 取り込んだ「理論式」を立ててパラメータフィッティングを行う 必要がある。

Athena/Artemis を使うなら、Artemis の出番。



XAFSスペクトルは周辺原子までの 「距離」には依存するが、「方向」には依存しない。

同一種、等距離の原子の集合=シェル



青原子4個が乗る青い丸はシェル 「第1シェル」「最近接シェル」…

赤原子4個が乗る赤い丸もシェル 「第2シェル」「第二近接シェル」…

緑原子は、種類が違うので第2シェル には入れられない。独立のシェルを 作る。

EXAFS解析を行う際の一つのユニット。







 ・一つのシェルに属する原子までの距離が多少異なっていても 「構造の乱れ」とらえて、一つのシェルだとみなす。

・左の例は、原子位置が「ランダム」にズレているので

「乱れ」と捉えるしかない

・右の例は、規則的に配置がズレているので、二つのシェルに

分けて考えることも可能。

- 1) 解析の目的としてこの距離の差を区別して情報を得たいか
- 2) そのためにはパラメータの数が増えてしまう(解析の精度が下がる) デメリットを受け入れられるか

一つのシェルに対する EXAFS の理論式 (解析のスタート地点)





EXAFSスペクトルに含まれる情報

注意: χ(R) のピーク位置は 原子間距離Rそのものではない。!!



EXAFSスペクトルに含まれる情報

注意: χ(R) のピーク位置は 原子間距離Rそのものではない。!!

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

振動の周波数が $R + C_1$ に変わったことになるので フーリエ変換したときのピーク位置も $R + C_1$ の位置にズレる。 一つのシェルに対する EXAFS の理論式 (解析のスタート地点)

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

各シェルに対してこの式が書ける

従って全体としては、

$$\chi(k) = \sum_{R, \, Element} \chi_{R, \, Element}(k)$$

多くの場合、複雑になりすぎる!

フーリエフィルタリング (2重フーリエ変換)



一つのシェルに対する EXAFS の理論式 (解析のスタート地点)

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

たった一つのシェルに着目しただけで こんなに多数のパラメータがある式を使って どうやって解析を行うのか?

EXAFSスペクトルに含まれる情報



ポータブルなパラメータは 「中心原子」、「中心原子と散乱原子のペア」の種類だけに依存する。

「中心原子」、「原子ペア」が同じなら他の系でも 同じ値を持つと考えて良い。

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量 S_0 、N、f、R、 ϕ 、 σ 、 λ

1回の測定であらわにわかる独立の量は3つ。

- a) 振幅
- b) 振動のピークの位置
- c) 振動の個々のピークの高さ



$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量 S_0 、N、f、R、 ϕ 、 σ 、 λ

1回の測定であらわにわかる独立の量は3つ。
a) 振幅
S₀、N、(R)
b) 振動のピークの位置
R、Φ
c) 振動の個々のピークの高さ
f、σ、λ、(R)

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量 S_0 、N、f、R、 Φ 、 σ 、 λ

「標準」試料(N、R: 既知、 σ 、 λ : 適当に仮定)を測定。

a) 振幅 *S*₀、*N*、(*R*) b) 振動のピークの位置 *R*、*Φ* c) 振動の個々のピークの高さ *f*、*σ*、*λ*、(*R*)

 $\rightarrow S_0$ 、 Φ 、fが決まる。

$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

XAFSの式に含まれる未知量 S_0 、N、f、R、 Φ 、 σ 、 λ

「未知」試料(N, R: 未知、 σ, λ : 適当に仮定)を測定。 (S_0, Φ, f は「標準」試料で決定済み)

a) 振幅 *S*₀、*N*、(*R*) b) 振動のピークの位置 *R*、*Φ* c) 振動の個々のピークの高さ *f*、*σ*、*λ*、(*R*)

 $\rightarrow N$ 、R、f(原子種、組成)が決まる。

本当の EXAFS スペクトル解析は 2ステップ

第1ステップ

- 「標準」試料(N, R: 既知、 σ, λ : 適当に仮定)を測定。 a) 振幅 $S_0, N, (R)$
 - a) 振幅 S₀、N b) 振動のピークの位置 R、Φ
 - c) 振動の個々のピークの高さ $f, \sigma, \lambda, (R)$ $\rightarrow S_0, \Phi, f$ が決まる。

第2ステップ

- 「未知」試料(N、R: 未知、 σ 、 λ : 適当に仮定)を測定。
 - a) 振幅 $S_0, N, (R)$
 - b) 振動のピークの位置 R、**Φ**
 - c) 振動の個々のピークの高さ $f, \sigma, \lambda, (R)$
 - $\rightarrow N$ 、R、f(原子種、組成)が決まる。

Artemis を使うと、第1ステップをシミュレーション(FEFF)で 済ますことができるので一見、第2ステップしかないように見える。

ここで使った記号とArtemis で使う記号の対応 「XAFSの式に含まれる未知量 S_0 、N、f、R、 ϕ 、 σ 、 λ 」

| ここで の記号 | Artemis の記号 | 各シェルに対して Athena で割振る 変数名(この講習会) | |
|-------------|----------------|---------------------------------------|---|
| S_{0}^{2} | S_{0}^{2} | AMP, AMP1, | |
| Ν | Ν | 1 | 理想的な配位数 |
| R | ΔR | delr, delr1, | 標準の距離を R_0 とした時 $\Delta R = R - R_0$ |
| σ^2 | σ^2 | ss, ss1, | |
| | ΔE_0 | | エネルギーの原点変更 |

Artemis に関するもう一つの注意点

Artemis で標準試料のパラメータを FEFF を使って計算する場合、 プログラムの流れに従うと

 Atoms に構造の情報(cifファイル等)を渡して FEFF の入力ファイルを作る
 FEFF で計算を行い、Artemis で使う 後方散乱振幅、位相因子を得る

という手順になる。このため、XAFS解析のためには あらかじめ「構造情報」を得る必要があるように思われがち。

ほんとうは、Atomsの使用は必須では無い !!!!!

(EXAFSの理論式には距離は出てくるが立体配置は含まれない)

「吸収原子種」、「散乱原子種」、「2原子間距離(仮の数値)」 だけを書いた FEFF の入力ファイルを準備すれば十分!!!!

> Atoms + FEFF は、むしろ Athena を使ってスペクトルを 絵として眺めるときに使いましょう。



$$\chi(k) = \frac{1}{k} S_0^2 \frac{N}{R^2} |f(k,\pi)| \sin(2kR + \phi(k)) \exp(-2\sigma^2 k^2 - 2\frac{R}{\lambda})$$

(In_xGa_{1-x})As のAs 周りの構造を知りたい。

1) 標準試料として GaAs, InAs を準備し、測定する。

2)
$$N$$
(=4), R (As-Ga=2.45, As-In=2.62) は既知。
 σ (=0.05)は仮定。 λ (=0)は無視。
 \rightarrow 未知だった S_0 , f_{As-In} , f_{As-Ga} , Φ_{As-In} , Φ_{As-Ga} が決まる。

3) 構造未知の InGaAs を測定する。 $S_0, f_{As-In}, f_{As-Ga}, \Phi_{As-In}, \Phi_{As-Ga}$ が分かっているので、 $\chi(k) = x \chi_{As-In}(k) + (1-x) \chi_{As-Ga}(k)$ と考えてフィッティングすると $\rightarrow x, N_{In}, N_{Ga}, R_{As-In}, R_{As-Ga}$ が決まる。

- 6. 半導体/固体材料
 - ・Er添加InPのXAFS測定

III-V 族化合物半導体へのEr添加



Semimetal/semiconductor heterostructures

Semimetal:

(*RE*)*As*, (*RE*)*P*: *NaCl-type* ErP (a = 0.5606nm, ρ = 150μΩcm) ErAs (a = 0.5732nm, ρ = 150μΩcm)

Semiconductor:

III-V semiconductors: zincblende-type InP (a = 0.5869nm) GaAs (a = 0.5653nm)

Mismatch:

 $\Delta a/a = -4.5\%$ for ErP/InP +1.4% for ErAs/GaAs

Applications:

Metal-base transistor Hot-electron transistor Resonant-tunneling transistor etc.



InP/ErP/InP heterostructure

PLスペクトルの成長温度依存性


◇ 成長方法:減圧有機金属気相成長(OMVPE)法
◇ In 原料: TMIn (trimethylindium)
◇ P 原料: TBP (tertiarybutylphosphine)
◇ Er 原料: Er(MeCp)₃ (trimethylcyclopentadienylerbium)

| 試料 | 成長温度 Tg[℃] | Er 原料供給 水素流量[sccm] | Er 濃度 [Er] [cm ⁻³] |
|----|---------------|-----------------------|-----------------------------------|
| #A | 550 | | |
| #B | 580 | 50 | 2×10^{18} |
| #C | 610 | | |
| #D | 530 | 125 | 8×10^{18} |
| #E | 580 | 123 | 0 ~ 10 |

(Er 濃度は二次イオン質量分析(SIMS)法により測定)

測定されたXAFSスペクトル



高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 放射光研究施設 BL12C

測定から得た動径分布関数





Er 原子位置のモデル







理論計算との比較



PLスペクトルの成長温度依存性とEr原子位置の関係

Substitutional Er in In site

